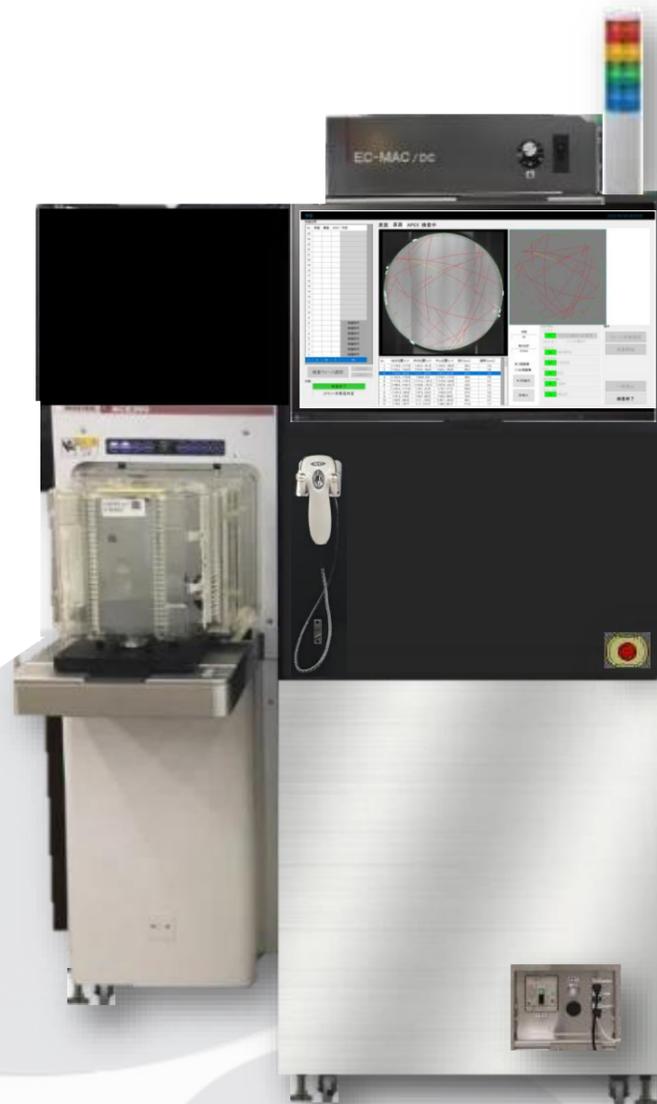


PW-EPI ウェハ検査装置

PW-EPI WAFER INSPECTION SYSTEM

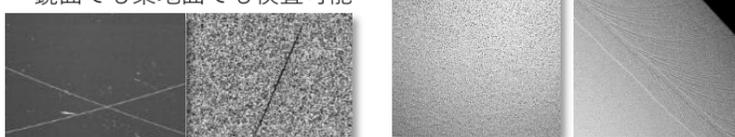
- ウェハの微細なキズを特殊な光学系と画像処理で検出。
- EPIウェハのスリップの検出、長さ測定。
- ノッチのAPEXも高感度検査。

特許出願中



検査対象 Inspection target

- ・目視や顕微鏡では検出困難なキズを特殊光学系で映し出し検出
- ・鏡面でも梨地面でも検査可能



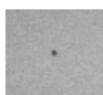
・鏡面の中の面荒れや模様を検出



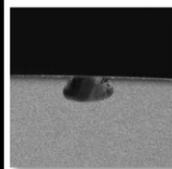
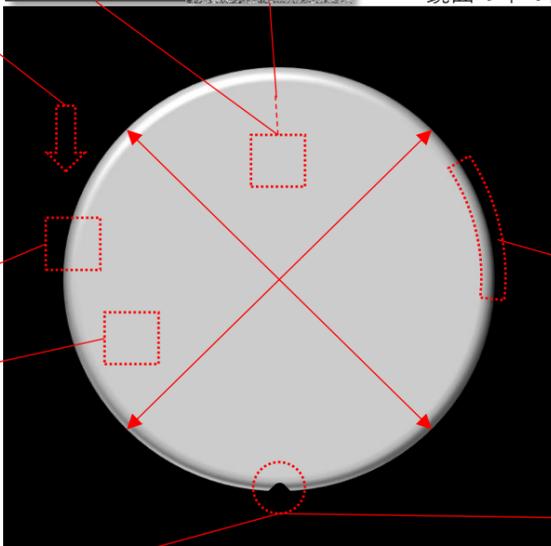
- ・プロフィール測定
- ・ベベルやAPEXの角度、寸法測定
- ・ロールオフ測定



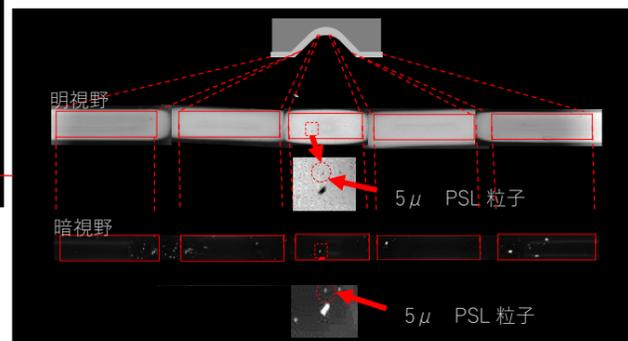
・スリップ検査



・赤外線や特殊光学系による内部検査 (ポイド・ピンホール)



・エッジキズ、チッピング



明視野

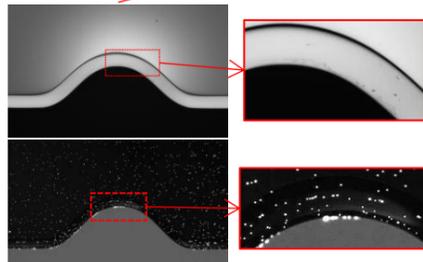
暗視野

5μ PSL 粒子

5μ PSL 粒子

※ウェハのあらゆる寸法の測定が可能です。

- ・直径測定
- ・オリフラ寸法測定
- ・コーナー測定

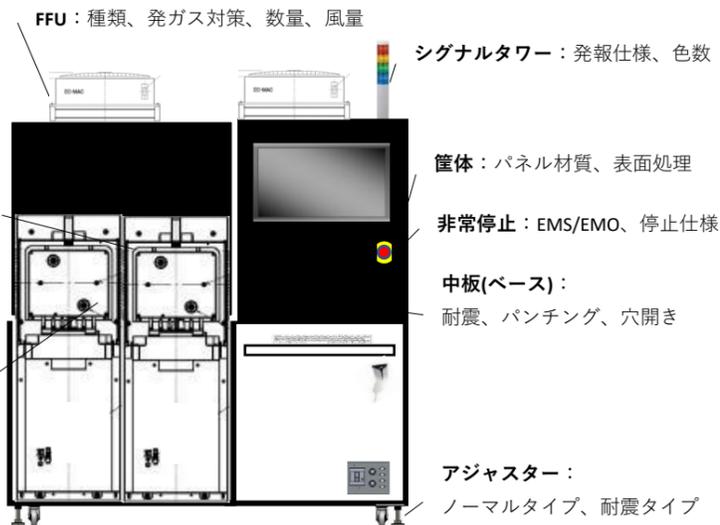


・白い点は1μmのPSL粒子

装置仕様 Specification

※お客様のニーズに合わせてカスタマイズいたします。

【カスタマイズ】



カセット・キャリア：
ウェハサイズ、種類、
数量、搬送シーケンス

マップター：
ウェハ有無、斜め収納、
同一SLOT複数収納、

【一般仕様】

| | | |
|-----------|---|---|
| ウェハサイズ | ～Φ300mm | |
| 検出可能な欠陥 | 表面・裏面 | クラック、キズ、汚れ、スリップ、ビット、ピンホール |
| | エッジ・ノッチ | チッピング、キズ、汚れ |
| | 内部 | ポイド、ピンホール |
| 検出器 | エリアセンサー(5M) or ラインセンサー(8K,16K) | |
| 光源 | LED or レーザー励起光源 | |
| 搬送方式 | 搬送アーム | 樹脂、ケムラツ、セラミック on テフロン or PEEK or コーティング |
| | アクチュエーター | 裏面吸着、落込み、ベルヌーイ、エッジグリップ |
| ロードポート | FOUPオープナー付 1基～ | (オプション：RFID) |
| マッピングユニット | ウェハ検知、2枚重ね、斜め検知 | |
| スループット | 70秒/枚 = 1750秒 (≒30分(表裏面・エッジ検査の場合))/カセット | |
| 装置サイズ | W:1250 x D:1400 x H:1980 | (1ロードポート、表裏面・エッジ検査の場合) |
| 重量 | 500～1500kg | |
| 通信 | GEM300, SECS II など | |

■上記SPECは一般的なものであり、仕様内容により変動します。

オプション Option

- 自己診断機能
 - ・装置の経年変化や消耗による感度や精度の劣化を防ぐ為に、自動的に装置の状態を監視し適正な設定値に調整します。
- オフライン検査結果
 - ・装置が動作中でも過去の検査結果を閲覧する事が出来ます。
- 通信
 - ・GEM, GEM300, SECS, SECS II やその他工場内通信などが可能です。
- ウェハ搬送
 - ・OHT, AGVなどのウェハ搬送方式に対応可能です。



株式会社 昭和電気研究所

<http://www.showalabo.co.jp>

✉ info@showalabo.co.jp

〒819-0015 福岡市西区愛宕1丁目14-35

PHONE : 092-881-0238 FAX : 092-881-0217

■本カタログの仕様に付いては、予告なしに変更する場合がございます。